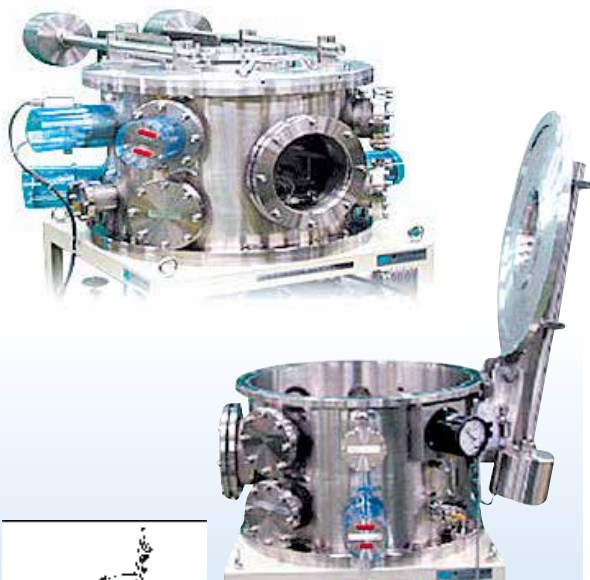


真空チャンバー

小型真空チャンバー



上部開閉式で大型の窓を持ち、
供試体の取扱いや確認が容易

宇宙環境を想定した環境下で供試体の評価を行うための
真空環境模擬装置で、供試体を温度制御するための過熱、
冷却機能を有しています。

特徴

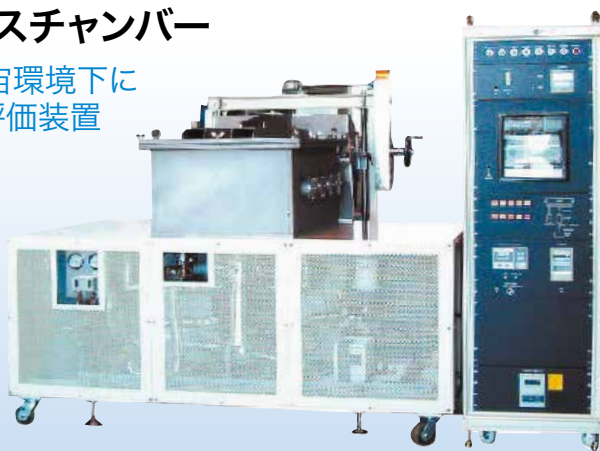
- バランス錘を設けた上部蓋による開閉方式で、チャンバー内部の作業が容易です。
- 目視およびカメラ監視などのために、上部蓋と胴部正面に大きなφ210の窓を設けています。
- 防振対策により、供試体への振動の影響を低減しています。
- コンピューターによる真空・温度制御などの運転操作やデータの取込が可能です。

仕様

- 概寸法: ID650×H400mm
- 架台寸法: 約800×800×H600mm
- 到達真空度: 1.33×10^{-4} Pa以下
- 温度制御: -100℃～150℃
- 温度制御精度: $\pm 2.0^\circ\text{C}$
- 温度分布: $\pm 5.0^\circ\text{C}$ /無負荷時
- 温度制御方式: ヒータ加熱、LN₂冷却
- 供試体プレート: Cu 300×300×t15～25mm
- 材質: チャンバー部SUS304、フランジ部アルミニウム
- 内面、外面処理: 酸洗
- 真空排気セット架台内組込、温度制御器は別置き、架台内組込も可

スペースチャンバー

模擬宇宙環境下に
於ける評価装置



仕様

- 温度範囲: -35～+80℃
- 到達真空度: 2.66×10^{-5} Pa
- 冷却能力: 負荷、max. 1.5KW(at+20℃)
- 温度制御精度: $\pm 2.0^\circ\text{C}$
- 温度分布: $\pm 3.0^\circ\text{C}$ /無負荷時
- 供試体プレート寸法:
W800×D400(mm) 及び W1000×D800(mm)

大型チャンバー

真空排気の冗長性を考慮した
高真空排気装置を2台装備



仕様

- 堅置円筒片側ヒンジ扉開閉式
- 寸法: ID1600×450mm
- 温度制御範囲: -40℃～+80℃
- 温度制御精度: $\pm 2.0^\circ\text{C}$ 以内(制御点にて)
- 到達真空度: 1×10^{-5} Pa/2.0hr.
- 供試体プレート寸法: φ1600(mm)